

CKD

参展邀请

SEMICON[®] JAPAN

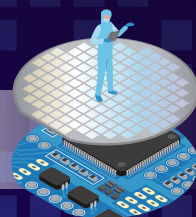
举办日期 12/17 (周三)~19 (周五)

观展时间 10:00~17:00

举办场馆 东京Big Sight

CKD展位 南1厅 S1505

支撑半导体市场的精密系统元件



集成化供气系统
IAGD



气控阀
AGD (高温、高耐久)



工艺气体流量诊断单元
TPB



减压阀
PGM



Gas-Facilities



Gas Supply



Deposition



Ion Implantation



Etching

Gas-Vacuum process



气控阀
AVB



压力制御系统
IAVB



比例制御系统
VEC-R



GAS control

VACUUM control

气控阀
AMD※※3R



气控阀 (集成型)
GAMD※※3R



气控阀 (无金型)
AMD※1M



手动阀
MMD※03RN



Chemical-Facilities



Chemical Supply



Cleaning



Resist Coating



CMP

Chemical process

电动流量调节阀
MNV



先导式减压阀
PMP



精致液位开关
KML



CHEMICAL control

自1980年代起,我们凭借“深厚的技术积淀”、“核心部件的全链自研”与“制程的严苛管理”,持续赋能半导体制造,致力于推动半导体工艺的精进与产品良率的提升。

生产效率的提升

直动式3通阀3QR系列

高速涂布、筛选用

3QR 高响应规格

瞬间响应, 畅快操作

响应时间ON: $2 \pm 0.5\text{ms}$

(JIS B 8419: 基于2010动态性能测试的初始值)

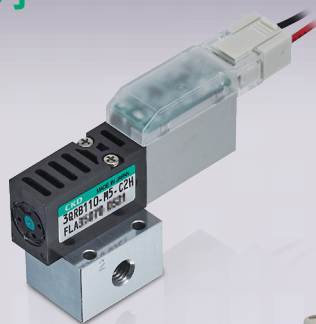


电池驱动、连续通电用

3QR 宽电压电源规格

焕新上市

宽电压电源线圈



高响应型DD马达 HD-4系列

追求高效动作的
高响应型新机型



误动作防止用阀

带联锁功能

MN3/4E0·MN3/4E00系列

实现个别供电与断电的联锁安全功能

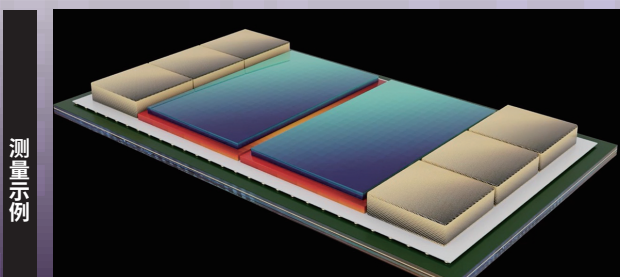
用于先进封装的高速三维检查装置

【测量示例】微凸块高度、铜柱、晶圆或基板翘曲、异物



特点

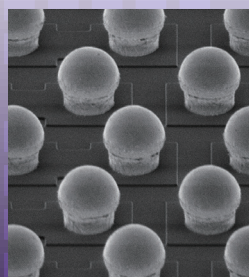
- 采用CKD自研(专利)的光学系统
高速测量: 32WPH
- 高分辨率: 水平分辨率 $1\mu\text{m}$
- 对应标准: SEMI S2, S8, CE



测量示例

- 微凸块高度
- 铜柱

- 晶圆或基板翘曲
- 异物

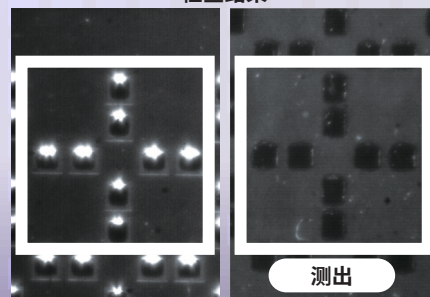


新型透明体检查装置

【测量示例】助焊剂检测、玻璃通孔检测

助焊剂检测

检查结果

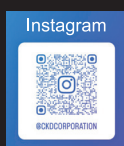


测出

玻璃通孔检测



从半导体前工艺到中后工艺, CKD凭借其综合技术实力, 为各类难题提供解决思路, 欢迎莅临我司展位交流指导。



CKD Corporation

〒485-8551 爱知县小牧市应时2丁目250番地

<https://www.ckd.co.jp/>

TEL: (0568)-74-1304

元件事业本部
销售促进部